

NUBIC 知的財産情報開示

開示日：2018年1月17日

各 位

NUBIC 知的財産情報の要約を公開いたします。

技術移転等を御希望の場合は、ホームページの「[NUBIC 技術シーズ案件申込](#)」フォームからお申込みください。各担当コーディネーターから御連絡申し上げます。

「[NUBIC 技術シーズ案件申込](#)」フォーム：

[TOP](#)>[共同・受託研究](#)>[申込書／契約書](#)>[本学研究シーズの利活用の申込み](#)>[WEB](#) から

出願番号 整理番号 担当者

表題	大気圧プラズマ生成装置		
発明の概要・応用	大気圧低周波 (LF) プラズマジェットは、プラズマの照射効果の再現性の悪さや、プラズマ生成に使用できるガス種が制限されることなどの問題があった。 そこでガス導入経路上に予備電離室を設けることで、ガス種やエネルギーなど、大気圧低温プラズマを生成可能な条件を拡大し、またその性能について再現性を格段に向上させることに成功した。		
発明の特徴・効果	従来の手法では生成が難しい Ar や希ガスと酸素の混合ガスによる大気圧低温プラズマが、容易に、また再現性よく生成可能できるようになった。この技術は材料の表面処理・修飾などの効率化に有効であり、また、医療応用分野における基礎研究において、その再現性の高さから有効に活用できるものと思われる。		
技術分野	電気・電子	食品・バイオ	



【問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南 4 - 8 - 2 4 日本大学会館

TEL : 03-5275-8139 FAX : 03-5275-8328 E-mail : nubic@nihon-u.ac.jp